

ミットヨ ISO/IEC 17025 (JCSS) 登録状況リスト

QA-E130032 Rev.25.0

2017-09-01 作成

株式会社ミットヨ

品質保証部

1. 長さ

	種類	校正の範囲	認定機関	認定番号	初回認定日	備考
計量標準キャリブレーション課	波長計量器	633nm 領域の波長	IAJapan /NITE	0067	2017-04-28	-
		532nm 領域の波長				
宮崎工場	ブロックゲージ	0.1mm 以上 1000mm 以下	IAJapan /NITE	0030	1994-05-02	光波干渉測定 比較測定
	各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの	1mm 超 2010mm 以下			2005-04-20	光波干渉測定
宇都宮キャリブレーションセンタ	標準尺	1000mm 以下	IAJapan /NITE	0031	1996-08-07	-
	ブロックゲージ	500mm 超 1000mm 以下			2003-03-25	光波干渉測定
		0.5mm 以上 1000mm 以下			1998-05-06	比較測定
	各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの	2100mm 以下			2003-03-25	光波干渉測定
		0.5mm 以上 1060mm 以下			2000-12-21	比較測定
	マイクロメータ (マイクロメータヘッドを含む)	500mm 以下 (マイクロメータヘッドは 25mm 以下)			2002-02-04	-
	ノギス	1000mm 以下				
	ハイトゲージ	1000mm 以下				
	デプスゲージ	1000mm 以下				
	ダイヤルゲージ校正器	100mm 以下				
	ダイヤルゲージ	100mm 以下				
	てこ式ダイヤルゲージ	1.6mm 以下				
	シリンダゲージ	6mm 以上 400mm 以下				2005-04-20
	電気マイクロメータ	±5μm、±200μm、±2000μm				
	リングゲージ	6mm 以上 120mm 以下				
	球(平均直径)	2mm 以上 40mm 以下				2013-02-07
広島キャリブレーションセンタ	ダイヤルゲージ	100mm 以下	IAJapan /NITE	0109	2002-04-11	-
	てこ式ダイヤルゲージ	1.6mm 以下				
	ダイヤルゲージ校正器	25mm 以下				
	ノギス	1000mm 以下				
	ハイトゲージ	1000mm 以下				
	マイクロメータ (マイクロメータヘッドを含む)	500mm 以下 (マイクロメータヘッドは 25mm 以下)				
	デプスゲージ	1000mm 以下				2005-07-07
	各種長さ測定用校正器で測定面が平面であるもの	25mm 以上 1000mm 以下				
	リングゲージ	6mm 以上 120mm 以下				
	指示マイクロメータ	マイクロメータ部: 100mm 以下 インジケータ部: ±0.06mm				2009-07-01
	表面性状	深さ: 0.3μm 以上 20μm 以下				2017-08-03
		算術平均粗さ: 0.1μm 以上 5μm 以下 最大高さ粗さ: 0.3μm 以上 20μm 以下				
	テクノサービス事業本部	座標測定機: 現地校正 (画像測定機を含む)			1000mm 以下 (画像測定機は 1000mm 以下)	IAJapan /NITE

2. 温度

	品目	校正の範囲	認定機関	認定番号	初回認定日	備考
宇都宮キャリブレーションセンタ	白金抵抗温度計	0°C 以上	IAJapan/NITE	0031	2003-12-10	比較測定
	指示計器付温度計	40°C 以下				

3. 力

	品目	校正の範囲	認定機関	認定番号	初回認定日	備考
川崎キャリブレーションセンタ	力計	10N 以上 2kN 以下	IAJapan/NITE	0086	2005-09-01	-

4. 硬さ

	品目	校正の範囲	認定機関	認定番号	初回認定日	備考
広島キャリブレーションセンタ	ロックウェル硬さ標準片	20HRC 以上	IAJapan/NITE	0109	2007-02-21	-
	ロックウェル硬さ試験機 (現地校正)	65HRC 以下				

NITE : National Institute of Technology and Evaluation (独立行政法人 製品評価技術基盤機構)

IAJapan : International Accreditation Japan (認定センター)

JCSS : Japan Calibration Service System (計量法トレーサビリティ制度)

2017-09-01 現在の認定状況